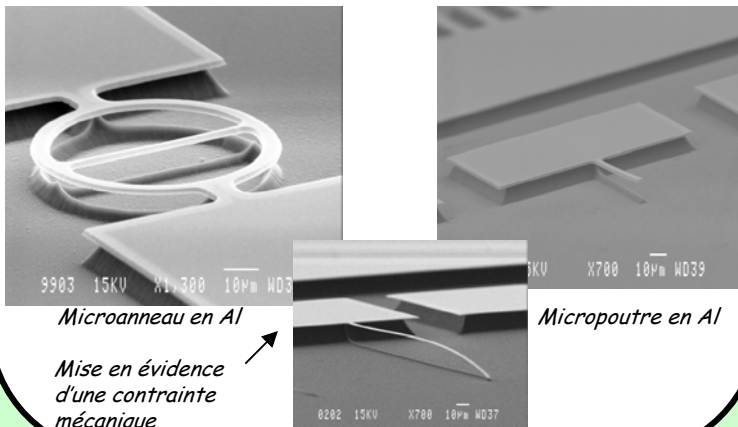
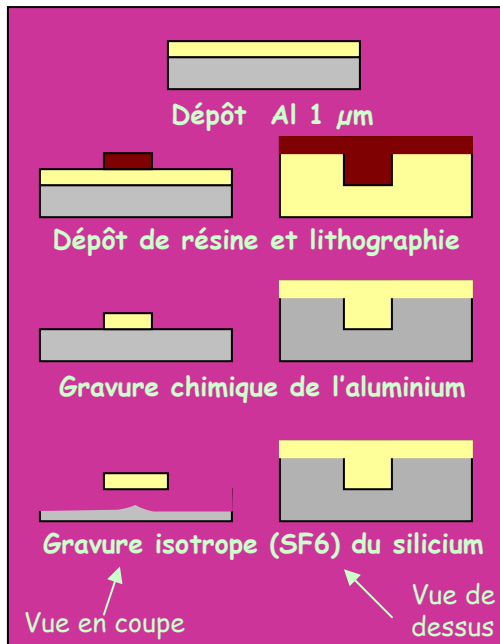


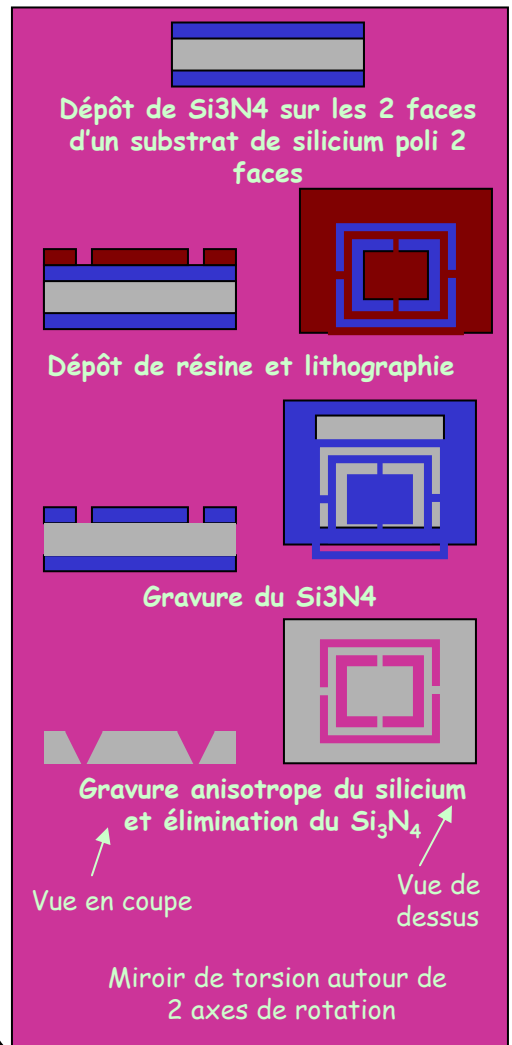
## OBJECTIFS :

Mise en œuvre des technologies de centrale technologique spécifique à la réalisation de microdispositifs suspendus (microponts, micropoutres, membranes, masse vibrante) pouvant être utilisés comme brique de base pour la fabrication de microdispositifs plus élaborés ou comme élément sensible pour la mise en évidence de propriétés intrinsèques du matériau et du procédé comme les contraintes mécaniques induites par exemple

### Elaboration de microponts et micropoutres



### Elaboration de micromiroirs



Appareillage utilisé : hotte de nettoyage, PECVD, évaporateur par canon à électron, aligneur, réacteur de gravure humide, RIE

Niveau : A partir de BAC + 4, formation permanente

Durée : 8h en salle blanche

Taux d'encadrement : 5 étudiants par groupe en centrale technologique, 50 étudiants en tout en 2003-2004

Formations concernées : DEA, Ecole Supérieure d'Optique, Ecole centrale, ENSTA, stage CEETAM

Contact : Elisabeth Dufour-Gergam, tél. : 01 69 15 77 23, e mail : elisabeth.dufour-gergam@ief.u-psud.fr